砥石作業面の3次元解析システム開発

松尾 修二*¹, 川下 智幸*²

*¹ 佐世保工業高等専門学校技術室,*² 佐世保工業高等専門学校電子制御工学科

要旨

現在、砥石を用いる生産現場では、砥粒切れ刃の分布や突き出し量の解析が工作物の品質や砥石寿命の判定に重要な役 割を果たすことをメーカー、ユーザーともに認識しているにもかかわらず砥石作業面の砥粒切れ刃分布や砥粒の突き出し 量の解析は積極的には行われていない.この現状から砥石作業面の砥粒切れ刃の分布・形状を正確に計測することが可能 となれば加工仕上げ面の良否や砥石寿命の判断も可能となり研削工程の効率化、高精度化につながると考えられる.本研 究では開発した砥粒切れ刃の3次元計測システムを用いて、研削過程での砥粒切れ刃の変化形態を追跡解析した.その結 果、本計測法を用いることで砥粒切れ刃表面層の破壊形態を計測、解析できることが分かった.

1. 緒言

加工表面が砥粒切れ刃の転写型で形成される場合、その加工表面の凹凸形状は砥粒切れ刃の分布・形状に左右される. 従って高平滑加工を実現するには砥石作業面の砥粒切れ刃表面層の状態を数値的に解析する必要がある.このようなこと から本研究では、開発した砥粒切れ刃3次元システム¹⁾⁻⁷⁾を用いダイヤモンド砥石とCBN砥石を用い、研削過程での砥 粒切れ刃表面層の追跡解析を行ったので以下に報告する.

2.実験装置及び砥石作業面の3次元計測システム

図1に実験装置の外観を示す.砥石作業面画像は、砥石軸上部に固定したマイクロスコープからインターフェースボードを介してコンピューターへ取り込み、画像処理を行うことで砥粒切れ刃の分布・形状や突き出し量を検出する¹⁾⁻⁵⁾.砥石 全体の作業面において、マイクロスコープの上下方向(Z軸)、砥石軸方向(X軸)および砥石回転方向(回転軸)は、そ れぞれリニア式、ロータリー式のエンコーダを取り付け、作業面とマイクロスコープの位置関係をµm単位で管理し表示 している.これにより研削過程でも同一作業面、同一砥粒切れ刃を正確に追跡計測することができる.

表1、表2に画像処理の装置仕様および実験条件を示す.画像は、680×480 画像、1 画素あたりR、G、B(赤、緑、青)それ ぞれ8ビットの濃度階調を持つフルカラー画像で、解析ソフトでは原画像と画像処理後の画像を、同時に毎秒5フレーム 弱の速度で処理・表示している.画像処理による砥粒切れ刃解析の主な流れは、(1)メディアンフィルタによる平滑化の 有無(2)色相、明度、彩度のヒストグラムから選択し、適切なしきい値設定の2値化処理(3)雑音の除去と補正(4) 数値解析により作業面状態の数値化;からなる一連の処理を行っている.研削加工は、(株)岡本機械製作所製の平面研削 盤を用いた.工作物にダイヤモンド砥石の場合はSiC、CBN砥石の場合はSKD11の焼き入れ材を使用している.両 砥石とも表2に示す条件で目直し、形直しを実施し、同一設定条件下で研削を行い、同一砥石作業面の砥粒切れ刃を3次元 で計測解析した.また、工作物の仕上げ面粗さ(3次元計測器:WYKO)や研削抵抗などの計測も一部で行った.

Territoria (Anal	Grinding machine	Okamoto
R1/2027-7	Grinding wheel	SD140Q100M CBN140Q1001
	Truing	Multipoint diam Wheel speed: Table speed: V Depth of cut:
ענו 1	Dressing	WA stick #32 Wheel speed: Table speed: V Dpeth of cut: 1
GER Barnets	Grinding	Workpiece: SiC : SKE Wheel speed: Table speed: v

Fig.1 View of experimental apparatus

		Table.2 Grinding conditions					
	Grinding machine	Okamoto Machine Tool Work , Ltd		Table.1 Specification of measuring system			
	Grinding wheel	SD140Q100M		Microscope VH-Z Series Keyence Corp. diameter X 100~1000			
Truing	Truing	Multipoint diamond truer SD100P (30×30) Wheel speed: Vt= 20 m/s		Personal Computer	Dell LATIDUTE D520 CPU: Celeron M 1.73GHz RAM:SDRAM 1GHz		
	Depth of cut: tt=	Depth of cut: tt= 5 µm / pass		Capturer-board	THE IMAGESOURCE DFG/USB2-It		
	Dressing	WAstick #320 Wheelspeed:Vd = 20 m /s Table speed:vd= 0.033 mm /s Dpeth of cut:td= 50 μm / pass		OS Development Language	Microsoft Windows XP Pro Microsoft Visual C# 2005		
Grinding		Workpiece: SiC (HP)	1			Position precision	
	: SKD11 HV≒800 Wheel speed: Vg = 20 m / s Table speed: w= 0.033 mm / s Dpeth of cut: t= 1 µm / pass Coolant fluid: Soluble (1/50 in water)		Position Control	X-Axis	1µm		
				Z-Axis	1µm		
				Rotation-Axis	360° /4096		

3.実験結果および考察

図2にダイヤモンド、CBN両砥石において研削過程で同一砥粒切れ刃を追跡し計測解析した結果を示す.画像から切 れ刃を抽出した2値化画像より、画像内における砥粒切れ刃逃げ面が占める面積を砥粒切れ刃面積率()として解析し 原画像と同時に示す.図のようにダイヤモンドの場合は、研削が進むにつれて逃げ面が平坦部を形成しながら増加するこ とから も増加している.破壊は、逃げ面の端面部から比較的大きなものがみられる.CBN の場合は、原画像および画像処 理による解析結果のから判断しても、研削課程では切れ刃逃げ面が増加しつつ、同時に逃げ面内で細かな破壊を繰り返 していることがわかる.このような現象は、1個の砥粒内で発生する自生発刃作用とも言える.その逃げ面の凹凸を計測し たところ5~10μmの比較的浅い凹凸であることがわかった.この解析結果から、今回用いた砥粒の粒径は約100μ mではあるが、1個の砥粒の中で複数個の砥粒切れ刃として研削に関与していることが考えられる.図3は,ダイヤモン ド, CBNの砥粒切れ刃表面層の形態を模式図で示したもので, 逃げ面は, ダイヤモンドは平坦で, CBNの場合は, 5 ~10µmの凹凸を形成していることを表している.図4は、研削過程における平均砥粒切れ刃面積率((av))を示し たものである.ダイヤモンドの場合は画像(0.72×0.96mm²)72枚、CBNの場合は画像(0.27×0.36mm²)144枚を 用いて解析し平均値((av))を求めている.ダイヤモンドの場合は、研削が進む過程で は増加し、CBNの場合は、ほぼ 一定値を示していることが図から読み取れる. СВ Nの場合、図2で示した砥粒切れ刃の変化形態と図4が示す傾向とを 比較しても、切れ刃の面積の割合は増加しないと考えられる.なおCBNの場合、研削抵抗を研削過程で計測したところ、 ほぼ一定値を示した.また、工作物仕上げ面粗さは約Ra=0.25µmと同じ値を示した.ダイヤモンドの場合は研削過程で 仕上げ面粗さの向上⁸⁾がみられ、この違いは研削に関与する砥粒切れ刃の割合が影響していると考えている.

今回、開発した計測システムを用いることで研削に関与する砥粒切れ刃表面層の細かい破壊形態まで定量的に数値化で きることがわかった.今後は、このような砥粒切れ刃形状が転写型で形成される仕上げ面粗さの凹凸形状にどのような影 響を及ぼすのか、検討を進めるなど数値化した砥粒切れ刃の情報の有効活用法を明らかにすることで本計測システムの普 及に努めたい.



Fig. 4 Change in cutting edge ratio with material removed per unit width